

研究テーマ名	UBMS法による極印の表面処理に関する研究
研究内容抄録	<p>極印にDLC (Diamond-like carbon) 被膜し、命数の向上を図ってきたが、平成26年度においては、DLC膜の実用化に関する調査を行い、極印硬度や密着力に影響を与えるのはバイアス電圧とメタン流量であることが分かり、最適条件を確認できた。</p> <p>また、プルーフ貨幣用極印への応用の確立については、極印によってはマスキングを施し、手研磨と自動研磨の併用による方法が最適であることを確認した。</p>
学会発表	塑性加工国際会議「11th ICTP (International Conference on Technology of Plasticity) 2014 (Nagoya Japan)」